

# КАТОД С ИМПУЛЬСНЫМ НАГРЕВОМ ЭМИТИРУЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ

В. И. ВОЛОСОВ, В. Е. ПАЛЬЧИКОВ, Ф. А. ЦЕЛЬНИК

Институт ядерной физики СО АН СССР, Новосибирск

(Получено 26 апреля 1965 г.)

Для увеличения плотности тока эмиссии катода, работающего в импульсном режиме, используется дополнительный импульсный нагрев поверхности катода электронным пучком. Дан расчет этого нагрева, и сообщены результаты экспериментов. Получена плотность тока до  $70 \text{ а/см}^2$  в импульсе — 2 мксек при использовании tantalового катода.

1. Максимальная плотность тока эмиссии, отдаваемого металлическим катодом, ограничивается обычно тем, что при температурах, близких к температуре плавления материала эмиттера, последний быстро разрушается и срок службы катода резко падает. Кроме того, при больших ускоряющих потенциалах может возникать пробой у поверхности катода из-за относительно высокого давления паров материала эмиттера при этих температурах.

Г. И. Будкер предложил использовать для катода, работающего в импульсном режиме с большой скважностью, импульсный нагрев поверхности катода электронным пучком до температуры, близкой к температуре плавления, что существенно увеличивает плотность тока эмиссии. Длительность нагревающего импульса  $\tau_1$  выбирается в пределах  $5 - 200 \text{ мксек}$  (рис. 1), энергия электронов в пучке  $eU_1 \sim 50 - 100 \text{ кэВ}$ . Величина области, нагревающейся до высокой температуры, определяется глубиной проникновения электронов, которая равна нескольким микронам при  $U_1 \sim 100 \text{ кэВ}$ , и глубиной, на которую распространяется тепло за время  $\tau_1$ , равной  $\sqrt{\kappa t_1}$ ;  $\kappa$  — коэффициент температуропроводности материала ка-

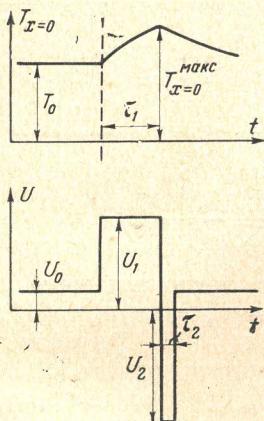


Рис. 1. Зависимости температуры поверхности катода  $T_{x=0}$  и напряжения на катоде  $U$  от времени

плавления, что существенно увеличивает плотность тока эмиссии. Длительность нагревающего импульса  $\tau_1$  выбирается в пределах  $5 - 200 \text{ мксек}$  (рис. 1), энергия электронов в пучке  $eU_1 \sim 50 - 100 \text{ кэВ}$ . Величина области, нагревающейся до высокой температуры, определяется глубиной проникновения электронов, которая равна нескольким микронам при  $U_1 \sim 100 \text{ кэВ}$ , и глубиной, на которую распространяется тепло за время  $\tau_1$ , равной  $\sqrt{\kappa t_1}$ ;  $\kappa$  — коэффициент температуропроводности материала ка-

тода. В таком режиме существенно возрастает срок службы катода, так как размеры области, нагретой до высокой температуры, малы и количество испаряющегося материала катода невелико из-за кратковременности нагревающего импульса. С другой стороны, молекулы испарившегося с поверхности катода материала, двигаясь с тепловыми скоростями (для tantalа  $\sim 4 \cdot 10^4 \text{ м/сек}$  при  $T = 3 \cdot 10^3 \text{ }^\circ\text{K}$ ), не успевают достичь анода за время импульса и вызвать пробой промежутка. Время остывания поверхности катода равно по порядку величины времени нагрева и, если импульс ускоряющего напряжения подается непосредственно после нагревающего импульса (рис. 1), возможно получение большой плотности тока эмиссии в течение всего импульса  $\tau_2$  (длительность  $\tau_2 \sim 1 - 10 \text{ мксек}$ ). Как будет видно из теоретических оценок, при указанных выше параметрах нагревающего пучка импульсный нагрев катода необходимовести не от комнатной температуры, а от температуры  $2000 - 2500 \text{ }^\circ\text{K}$ , при которой катод еще практически не разрушается. Эта температура поддерживается на катоде за счет постоянного нагрева тем же пучком электронов при пониженном напряжении нагрева  $U_0$  (рис. 1). При импульсном нагреве от комнатной температуры необходимая величина плотности нагревающего тока существенно возрастает и становится сравнимой с плотностью тока эмиссии.

Импульсный нагрев катода может осуществляться также токами высокой частоты. Однако этот способ нагрева менее удобен, так как при толщине скин-слоя, сравнимой с глубиной проникновения электронов (при нагреве пучком электронов), частота долж-

на быть столь велика, что основная часть энергии будет уходить на излучение. Кроме того, большие трудности возникают при создании мощной высокочастотной системы ( $f \sim 10^{10} \text{ Гц}$ ;  $W \sim 10^6 \text{ вт}$ ).

2. Вычислим температуру, до которой нагреется поверхность эмиттера. При энергии нагревающего пучка  $\sim 50 \div 100 \text{ кэв}$  основную роль играют потери на ионизацию. Уменьшение энергии электронов определяется формулой [1]:

$$-\frac{d\varepsilon}{dx} = \frac{4\pi e^4 N Z}{mv^2} \ln \frac{mv^2}{I}, \quad (1)$$

где  $NZ$  — число электронов в единице объема нагреваемого тела;  $I$  — средний потенциал ионизации. Пренебрегая изменением логарифмического множителя, можно получить в явном виде зависимость энергии электрона от  $x$ :

$$\varepsilon = \varepsilon_0 \sqrt{1 - x/\beta}, \quad (2)$$

где  $\varepsilon_0$  — начальная энергия электрона

$$\beta = \varepsilon_0^2/a; \quad a = 4\pi e^4 NZ \ln(\varepsilon_0/I) \approx 4\pi e^4 NZ \times \ln(\varepsilon_0/I).$$

Плотность мощности, выделяемой электронами в среде, равна (при равномерном распределении тока вдоль поверхности):

$$P(t, x) = n(t) \frac{dj}{dx} = \frac{\alpha j(t)}{8,4e\varepsilon_0 \sqrt{1 - x/\beta}}, \quad 0 < x < \beta. \quad (3)$$

Для упрощения выкладок ограничимся случаем прямоугольного импульса тока

$$j(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t < 0 \\ j & \text{при } 0 < t < \tau \\ 0 & \text{при } \tau < t. \end{cases}$$

Решение уравнения теплопроводности

$$\frac{\partial T}{\partial t} - \kappa \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = \frac{1}{\rho c} P(t, x) \quad (4)$$

известным образом записывается через функцию Грина оператора, стоящего в левой части, равную:

$$G = \frac{\sqrt{\kappa}}{2 \sqrt{\pi(t-t')}} \exp \left[ -\frac{(x-x')^2}{4\kappa(t-t')} \right]. \quad (5)$$

С учетом (5) имеем:

$$T = \frac{dj}{8,4 \sqrt{\pi \varepsilon_0 \rho c} \sqrt{\kappa}} \int_0^\beta dx' \times \int_0^\tau \frac{\exp \left[ -\frac{(x-x')^2}{4\kappa(t-t')} \right]}{\sqrt{(t-t')(1-x'/\beta)}} dt'. \quad (6)$$

Ищем решение при  $x = 0$ , так как нас интересует нагрев поверхности катода. После очевидных замен переменных получим из (6)

$$T_{x=0} = \frac{\alpha j \beta}{4,2 \sqrt{\pi \varepsilon_0 \rho c} \sqrt{\kappa}} \int_0^\tau dt \times \int_0^1 \frac{\exp \left[ -\frac{\beta^2}{4\kappa t} (1-y^2)^2 \right]}{\sqrt{t}} dy. \quad (6a)$$

Или, интегрируя по  $t$

$$T_{x=0} = \frac{Uj \sqrt{\tau}}{2,1 \sqrt{\pi \rho c} \sqrt{\kappa}} \int_0^1 \left\{ \exp \left[ -\frac{\beta^2(1-y^2)^2}{4\kappa\tau} \right] - V \frac{\beta(1-y^2)}{\sqrt{\kappa\tau}} \left[ 1 - \operatorname{erf} \frac{\beta(1-y^2)}{2\sqrt{\kappa\tau}} \right] \right\} dy. \quad (7)$$

При больших  $\tau$  интеграл в (7) стремится к 1 и

$$T_{x=0} \approx \frac{Uj \sqrt{\tau}}{2,1 \sqrt{\pi \rho c} \sqrt{\kappa}}. \quad (8)$$

Оценка (8) может быть легко получена из элементарных соображений с точностью до постоянного множителя  $\sim 1$ . Выражение (7) в общем случае не интегрируется. Ясно, однако, что кривая  $T_{x=0}(U)$  должна иметь (при заданном  $\tau$ ) максимум в области, где глубина проникновения электронов порядка величины скин-слоя. Интерес представляет лишь восходящая ветвь этой кривой — до максимума, так как дальнейшее увеличение энергии электронов не приведет к увеличению нагрева поверхности.

Покажем, что этот максимум находится в области  $\beta \ll \sqrt{\kappa\tau}$ . Разлагая подынтегральное выражение в (7) в ряд по величине  $\beta/\sqrt{\kappa\tau}$  и интегрируя, получим с точностью до членов второго порядка:

$$T_{x=0} \approx \frac{Uj \sqrt{\tau}}{2,1 \sqrt{\pi \rho c} \sqrt{\kappa}} \times \left( 1 - 1,2 \frac{\beta}{\sqrt{\kappa\tau}} + 0,34 \frac{\beta^2}{\kappa\tau} + \dots \right). \quad (9)$$

ТАБЛИЦА 1

$\tau_1, \text{ мксек}$	25	50	100	200
$U_1 \text{ макс, кв}$	90	110	130	155
$\frac{T_{x=0}^{\max}}{i}, \text{ э см}^2/\text{а}$	250	450	730	1200

Функция (9) имеет максимум при  $\beta/\sqrt{\kappa t} = 0,28$ , что и оправдывает ее разложение в ряд по  $\beta/\sqrt{\kappa t}$ . Это позволяет вычислить температуру нагрева поверхности катода во всей интересующей нас области с достаточной точностью.

На рис. 2 качественно показан ход кривых  $T_{x=0}(U)$ . Исходя из (9), рассчитана (табл. 1) энергия нагревающих электронов ( $U_1^{\max}$ ), соответствующая максимальному приросту температуры поверхности танталового катода при заданном  $\tau_1$  и величина  $(T_{x=0}^{\max}(j))$ . В табл. 2 приведены те же данные при постоянном  $U_1$  ( $U_1 = 60 \text{ кв}$ ) в зависимости от величины  $\tau_1$ .

Как видно из таблиц, для получения больших электронных токов с катода необходим предварительный подогрев его до  $(2 \div 2,5) \cdot 10^3 \text{ }^{\circ}\text{K}$ .

ТАБЛИЦА 2

$\tau_1, \text{ мксек}$	25	50	100	200	300	500	1000
$\frac{T_{x=0}^{\max}}{i}, \text{ э см}^2/\text{а}$	200	300	430	620	770	1000	1450

3. Исследовалась работа танталового катода ( $\phi = 2,0 \text{ см}$ ) в режиме импульсного нагрева. Перед катодом на расстоянии  $2 \div 4 \text{ см}$  располагался нагревающий катод (рис. 3) в виде решетки из натянутых параллельных вольфрамовых лент, поставленных ребром к нагреваемой поверхности. Прозрачность нагревающего катода для основного пучка электронов была  $\sim 90\%$ . Лен-

ты решетки соединялись последовательно и нагревались переменным током. Решетка укреплялась на заземленном диске и вместе с ним служила анодом для основного пучка. Нагревающий и ускоряющий импульсы подавались на катод через импульсный трансформатор. Катод предварительно нагревался до температуры  $\sim 2300 \div 2400 \text{ }^{\circ}\text{K}$  (эмиссия  $0,5 \div 1 \text{ а/см}^2$ ) электронным пучком при напряжении  $U_0$  в несколько киловольт. Нагревающий импульс имел параметры: напряжение  $U_1 = 40 \div 50 \text{ кв}$ ; ток  $4 \div 5 \text{ а}$ ; его длительность  $\tau_1$  менялась от 50 до 200 мксек. Нагревающий пучок был несколько перефокусирован из-за большого количества ионов, образующихся при ионизации этим пучком испаряющегося тантала; площадь катода, нагреваемая пучком, была  $\sim 2 \text{ см}^2$ . Предельный ток эмиссии, полученный в этих режимах при  $U_2 = 100 \div 200 \text{ кв}$ , был равен  $80 \div 140 \text{ а}$  (т. е. плотность тока  $\sim 40 \div 70 \text{ а/см}^2$ ), что хорошо совпадает с расчетными значениями тока эмиссии (поверхность катода за время импульса нагревается на  $400 \div 600 \text{ }^{\circ}\text{K}$ ). При  $\tau_1 > 200 \text{ мксек}$  наступал пробой промежутка анод — катод,

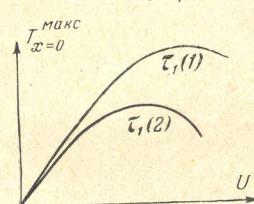


Рис. 2. Зависимость  $T_{x=0}^{\max}$  от амплитуды нагревающего импульса для различных значений  $\tau_1$  ( $\tau_1(1) > \tau_1(2)$ )

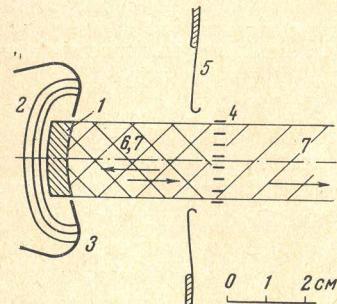


Рис. 3. Схематический разрез системы. 1 — основной катод, 2 — тепловой экран, 3 — фокусирующий электрод, 4 — нагревающий катод, 5 — диск, 6 — нагревающий электронный пучок, 7 — основной электронный пучок

что ограничивало величину импульсного нагрева. Работа катода фактически не зависит от вакуума; ограничения связаны лишь с пробоем промежутка катод — анод, начинаяющимся при давлении  $\sim 5 \cdot 10^{-5} \text{ тор}$ ; все эксперименты велись при  $\sim 1 \cdot 10^{-5} \text{ тор}$ . Срок службы катода ограничивался разруше-

нием нагревающего катода основным электронным пучком, причем вольфрамовый нагревающий катод выдерживает несколько тысяч импульсов предельной мощности. После длительной работы наблюдалось также небольшое оплавление поверхности катода, не оказывающее существенного влияния на фокусировку пучка.

Авторы выражают благодарность Г. И. Будкеру за обсуждение результатов и внимание к работе и К. П. Веселкову за изготовление узлов установки.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Экспериментальная ядерная физика (под ред. Э. Сегре), 1955, Изд-во иностр. лит.

УДК 535.232.6

## УСТАНОВКА ДЛЯ СНЯТИЯ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ФОТОПРИЕМНИКОВ

Н. Ш. ХАЙКИН

(Получено 12 июня 1965 г.)

Описана установка с ячейкой Керра, позволяющая снимать частотные характеристики фотоприемников в диапазоне  $1 \div 80$  Мгц. Вредное действие наводки устранено при помощи добавочной низкочастотной модуляции потока излучения и последующего анализа появляющихся при этом боковых гармоник сигнала, сдвинутых относительно частоты питания ячейки Керра на частоту низкочастотной модуляции.

Применение электрооптических элементов для снятия частотных характеристик фоточувствительности приемников излучения затруднено из-за наводки в цепи исследуемого сигнала на частоте модуляции света. Методы компенсации этой наводки, описанные в [1, 2], малоэффективны на частотах  $> 5$  Мгц. В данной статье излагается весьма простой метод исключения наводки и описывается построенная на его основе установка.

Сущность метода заключается в том, что поток излучения, промодулированный электрооптическим элементом, подвергается дополнительной низкочастотной модуляции с круговой частотой  $\Omega \geq (2 \div 3) \Delta\omega$ , где  $\Delta\omega$  — ширина полосы пропускания анализатора, регистрирующего фотоответ исследуемого приемника. Эта модуляция может осуществляться, например, механическим модулятором. Рассмотрим выражение зависимости интенсивности светового потока от времени при совместном действии синусоидальной низкочастотной и высокочастотной модуля-

ции:

$$\Phi(t) = \Phi_0 [1 + K_1 \sin(\omega_1 t + \varphi_1)] [1 + K_2 \sin(\Omega t + \varphi_2)] = \Phi_0 + \Phi_0 K_1 \sin(\omega_1 t + \varphi_1) + \Phi_0 K_2 \sin(\Omega t + \varphi_2) + \frac{\Phi_0 K_1 K_2}{2} \cos[(\omega_1 - \Omega)t + \varphi_1 - \varphi_2] - \frac{\Phi_0 K_1 K_2}{2} \cos[(\omega_1 + \Omega)t + \varphi_1 + \varphi_2], \quad (1)$$

где  $\Phi_0$  — постоянная составляющая светового потока;  $K_1$  — глубина;  $\omega_1$  — круговая частота;  $\varphi_1$  — фаза высокочастотной модуляции;  $K_2$  — глубина;  $\Omega$  — круговая частота;  $\varphi_2$  — фаза низкочастотной модуляции.

Из (1) видно, что в спектре зависимости потока излучения от времени имеются гармоники, сдвинутые относительно рабочей частоты  $\omega_1$  на  $\pm \Omega$ . Поскольку наводка в цепи фотоприемника имеет частоту  $\omega_1$ , целесообразно снимать частотную характеристику фотоответа, используя гармоники  $\omega_1 - \Omega$  или  $\omega_1 + \Omega$ .